研究速報

研

# 走査型力顕微鏡探針のねじれ固有振動振幅マッピング

Mapping of lateral vibration of the tip at a sub-atomic level in contact mode atomic force microscopy

河 岸 孝 昌<sup>\*</sup> · 加 藤 篤<sup>\*</sup> · 星 泰 雄<sup>\*</sup> · 川 勝 英 樹<sup>\*</sup> Takayoshi KAWAGISHI, Atsushi KATO, Yasuo HOSHI and Hideki KAWAKATSU

# 1. はじめに

接触式走査型力顕微鏡において短冊形カンチレバーと光 てこ変位検出機構を用いる場合、カンチレバーのたわみと ねじれが光りてこ機構の4分割フォトダイオードから検出 される. カンチレバーがフリースタンディングの場合. た わみとねじれのそれぞれの方向に、それぞれのモードに対 応した固有振動数での振動が検出される. たわみモードに 関しては, 試料との接触に伴い, その周波数は増加し, そ の振幅は小さくなる、これに対し、ねじれモードに関して は、周波数はほどんど変化せず、その振幅は試料によって 異なる.異なる試料に対して、このねじれ固有振動振幅が 変化することが観察されたので、 試料の xy 方向への走査 に伴う振幅の変化をマッピングした。その結果、シリコン と酸化シリコンのあいだでコントラストが得られ、グラフ ァイトの場合、数nmのステップを含む領域で明確なコン トラストが得られた、この可視化手法を説明し、コントラ ストメカニズムについて論じる.

### 2. 実験装置

ー般的な光てこ式走査型力顕微鏡において,光てこ検出 機構のフォトダイオードアンプに DC-800 kHz(-3dB) を用いた.カンチレバーのねじれ信号に含まれるねじれ固 有振動の周波数は,カンチレバーの寸法(幅のみ)により, 250 kHz(幅;40 µm)および450 kHz(幅;20 µm)であ った.このねじれ固有振動振幅を求めるために,図1に示 すように,ねじれ信号をバンドパスフィルター及びロック インボルトメータに通し,その結果得られる振動振幅の走 査に伴う変化をマッピングした.ロックインボルトメータ には,発信器から固有振動数(250,450 kHz)に相当する 参照信号を与えた.ロックインボルトメータは通常,数

\*東京大学生産技術研究所 マイクロメカトロニクス国際研究 センター

kHzからGHzまでの入力信号の振幅計測が可能であるため、この用途に適している. ロックインボルトメータ以外に両波整流器とローパスフィルタ、もしくは自乗和回路などを用いることも可能である.

### 3. 実験結果

図2にマイカとグラファイトを観察した場合の,探針走 査中のねじれ信号を示す.いわゆるスティックスリップを 反映した鋸波状の信号が観察される. グラファイトの場合, 鋸波状信号にカンチレバーのねじれ固有振動数に対応した 正弦波状信号が重畳している. 信号のサンプリング時間間 隔に対し、450 kHz のねじれ信号は早すぎるため、デジタ イジングエラーが生じている.そのため、上側2個のデー タに見られるピーク状のノイズは、実際は正弦波信号の一 部である、ここで特記すべき点は、両方の試料において、 フォトダイオードのねじれ信号の電気的フィルタリングが 同様であるという点である. つまり、グラファイトとマイ カで見られる、ねじれ固有振動振幅の差は、電気的要因に よるものではなく、探針先端、試料、コンタミナント、水 分等の影響で生じていると考えられる.図3にシリコンと 酸化シリコンからなる試料の観察結果を示す。この試料は、 酸化シリコン層が60 nm の SIMOX (separation by implanted oxygen) 基盤を用いて作製した.酸化シリコンの段差は 60 nm である. 試料の走査方向は, カンチレバーの長軸と 一致する方向に設定した.

図3(a)はトポグラフィー像、図3(b)はねじれ固有 振動振幅像(以下,振幅像)である.シリコンと酸化シリ コンでは,酸化シリコンの領域でより振幅が小さいことが 確認された.これは酸化シリコンが親水性であり,試料表 面の水分により固有振動振幅がダンピングされた為と考え られる.なお,時間経過に伴い,シリコンの親水性が増加 することはシリコン上の水球の形状により肉眼でも確認さ れるため,この試料はフッ酸でシリコン表面の酸化層を除 



去した後,直ちに実験を行った.図4にグラファイトの試料で,2nmの段差を含む範囲を観察した結果を示す.こ の領域に関しては,複数回走査しても安定して振幅像にコントラストが確認された.観察領域を変化させた場合,段 差があっても、コントラストの明確に得られる場合と、そうでない場合が観察された.コントラストの得られた場合 の,各領域の原子分解能での観察や,結晶方位の確認はまだ行っていない.



現在,振幅像のコントラストメカニズムを証明出来る段 階には至っていない.以下に検討すべき事項と,問題点, 改善点を列挙し,コメントを加える.

親水性と疎水性による振幅差の可能性

今までの実験では,親水性の試料でねじれ振動振幅 がより小さい.探針と試料の間を取り巻く水のダンピ



(a) 1.1  $\mu$  m  $\times$  1.1  $\mu$  m topographic image Step height: 60nm.



(b) 1.1  $\mu$  m × 1.1  $\mu$  m lateral vibration amplitude image (250kHz)

図3 シリコンと酸化シリコンの領域を含む試料のトポグラフィー像とねじれ固有振動振幅像





(a) 1.1  $\mu$  m  $\times$  1.1  $\mu$  m topographic image Step height: 2nm

(b)  $1.9 \,\mu$  m  $\times$   $1.9 \,\mu$  m lateral vibration amplitude image (250kHz)

図4 高さ2nmの段差を含む領域のグラファイトのトポグラフィー像とねじれ固有振動振幅像

52卷9号(2000.9)

#### 生 産 研 究 437

MARTINE CONTRACTOR CONTRACTO

ングが考えられる.

- 結晶方位による振幅差の可能性 観察領域を見失わずに試料を回転させ、コントラストの明暗の反転が生じるか否か、カンチレバーの主軸に対する各領域の結晶方位の関係と明暗の関係を調べる。
- その他、コントラストのつく原因
  段差通過時、カンチレバーが定常的にねじれを生じ、
  探針先端の、試料へのあたり方が変化することになる。
  この原因のみで振幅像にコントラストがついていると
  は思われないが、注意を要する。
- 探針先端が振動しているのか,探針が先端を中心にピボットしているのか

光てこ1個の信号のみからでは、判断が出来ない. そこでマイクロ並行バネ支持機構とレーザ干渉系を用 いた並進変位の検出を行う必要がある.

- 探針の振動と、試料の探針近傍の振動 試料の探針近傍の変位について観察の対象とすべき である。
- 高分解能で振幅像を観察する意味と問題点について スティックスリップによって、ねじれ信号は格子周 期でジャンプを起こすため、振動振幅演算回路がこの ジャンプによってアーティファクトの原因となる結晶 周期のうねりを出さないよう確認が必要である。

(2000年6月30日受理)

## 参考文献

1) H.Kawakatsu, Y. Hoshi, T.Kawagishi, abstracts of Nanotribology, April 2000, Bali.